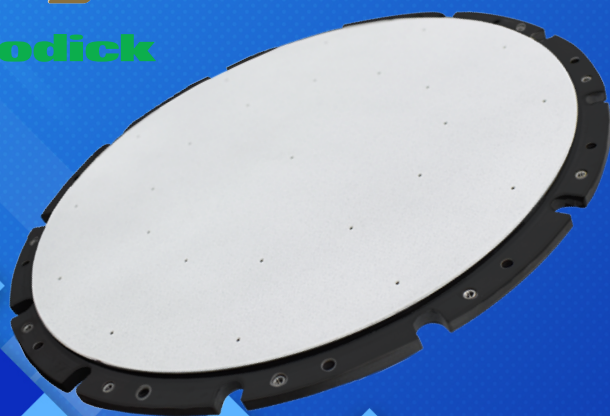




セラミックス静電チャック

半導体製造装置用・FPD製造装置用

クーロン力、ジョンソン・ラーベック力を用いた吸着方式。

セラミックステーブルの為、優れた平面度を維持可能。

真空下での使用も可能。

優れた絶縁抵抗と耐久性を発揮。

形 状	丸型静電チャック		四角型静電チャック
対象物（ワーク）	シリコンウエハ・ガラス・薄膜基盤・シート材 など		
最大外形寸法 (最大対応可能サイズ)	φ950mm × H15mm		W1600mm × D950mm × H15mm
総 重 量	約39kg		約83kg
平 面 精 度	10μm以下		20μm以下
使 用 環 境	大気下・真空下		
高 圧 電 源	入力：AC100V 出力：DC±3KV		
使 用 電 圧	2.5KV以下（推奨値） ※ワーク種・温度・湿度などの使用環境で変化します。		
吸 着 力（参考値）	クーロン力：0.3N/cm ² （無アルカリガラス DC+2KV時） ジョンソン・ラーベック力：5N/cm ² （SUS DC±0.5KV時） ※ワーク種・温度・湿度など使用環境で変動します。		

株式会社 **ソディック エフ・ティ EMTG** 事業部
Future Technologies

〒922-0336 石川県加賀市八日市町ホ 49-1

TEL.(0761)74-1119 FAX.(0761)74-1841

<https://www.sodick-ft.co.jp/ceramics/>

さらに詳しい情報はこちらのQRコードでスマホからアクセスいただけます！



当社HPはこちら